

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juli 2003 (24.07.2003)

PCT

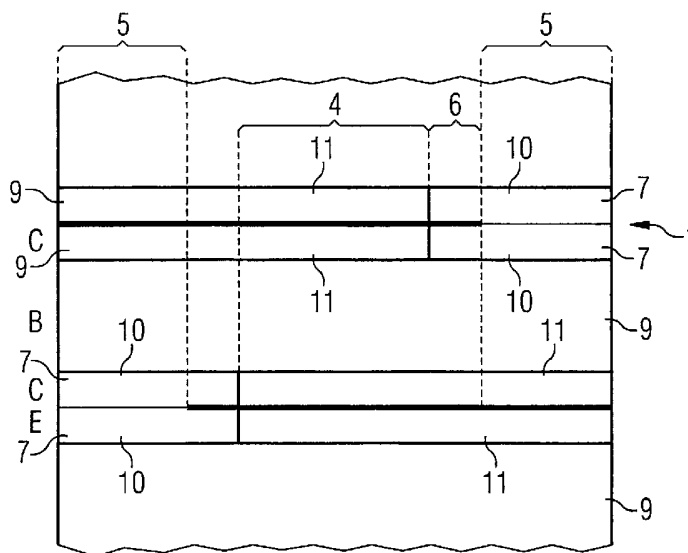
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/061022 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 41/083**, 41/24 (72) **Erfinder; und**
(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): FLORIAN, Heinz**
[AT/AT]; Klunkeraberg 79, A-8524 Bad Gams (AT).
RAGOSSNIG (GEB. GANSBERGER), Sigrid [AT/AT];
Tanzelsdorffg 1, A-8522 Gross St. Florian (AT).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/04249
- (22) Internationales Anmeldedatum:
18. November 2002 (18.11.2002) (74) **Anwalt: EPPING, HERMANN & FISCHER**; Ridler-
strasse 55, 80339 München (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (81) **Bestimmungsstaaten (national):** CN, JP, US.
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).
- (30) Angaben zur Priorität:
102 01 641.0 17. Januar 2002 (17.01.2002) DE
- (71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EPCOS AG** [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE). **Veröffentlicht:**
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** PIEZOELECTRIC COMPONENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) **Bezeichnung:** PIEZOELEKTRISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) **Abstract:** The invention relates to a piezoelectric component comprising a stack (1) of piezoelectric layers (2) lying on top of each other and electrode layers (3a, 3b) arranged between said piezoelectric layers (2). The electrode layers (3a, 3b) inside the stack (1) have a central segment (4) and an end segment (6) bordered by the inside of a vertical end area (5) of the stack (1). The end segments (6) of the electrode layers (3a, 3b) are surrounded by a first piezoelectric material (7), the relative extension of which is smaller than the relative extension of a second piezoelectric material (9) arranged in a central area (8) between two adjacent electrode layers (3a, 3b). The invention also relates to a method for producing said piezoelectric component. The inventive component has the advantage of reducing the mechanical stress near the ends of the inner electrodes, resulting in a longer life cycle for the component.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 03/061022 A2



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement mit einem Stapel (1) aus übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektrodenschichten (3a, 3b), bei dem Elektrodenschichten (3a, 3b) im Innern des Stapels (1) einen Mittelabschnitt (4) sowie einen von der Innenseite einer vertikalen Randzone (5) des Stapels (1) begrenzten Endabschnitt (6) aufweisen, bei dem die Endabschnitte (6) der Elektrodenschichten (3a, 3b) von einem ersten piezoelektrischen Material (7) umgeben sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materials (9), das in einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten (3a, 3b) angeordnet ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Bauelements. Das erfindungsgemässe Bauelement hat den Vorteil, dass die mechanische Belastung in der Nähe der Enden der Innenelektroden reduziert und damit die Lebensdauer des Bauelements verbessert ist.

Beschreibung

Piezoelektrisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement mit einem Stapel aus übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten und dazwischenliegenden Elektrodenschichten. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Bauelements.

10

Aus der Druckschrift DE 199 053 40 A1 sind piezoelektrische Bauelemente der eingangs genannten Art bekannt, die aus Keramikmaterial in Vielschichttechnik hergestellt werden. Als Keramikmaterial wird vorzugsweise PZT (Bleizirkonat-Titanat) verwendet. Die Bauteile weisen Innenelektroden auf, die nicht überall im Bauteil bis an den Rand des Stapels reichen. Dadurch entstehen sogenannte passive Zonen, bei denen sich durch Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen den Innenelektroden lediglich ein sehr geringes elektrisches Feld aufbauen läßt. In diesen passiven Zonen ist demnach das Keramikmaterial weitgehend unpolarisiert und trägt nicht zum Hub des piezoelektrischen Bauelements bei. Daneben gibt es aktive Zonen, bei denen benachbarte Innenelektroden direkt einander gegenüber stehen, wodurch bei angelegter Spannung ein hoher piezoelektrischer Hub erzeugt werden kann. Während in der aktiven Zone des Bauelements eine Druckspannung aufgebaut wird, sind die passiven Zonen des Bauteils Zugspannungen ausgesetzt. Die Materialbelastung ist dort am größten, wo die Innenelektroden im Innern des Stapels enden, also am Übergang zwischen aktiver und passiver Zone. Am Ende der Innenelektroden kommt es zu einer Überhöhung der elektrischen Feldstärke aufgrund von Spitzeneffekten. Die Feldlinien laufen im Endbereich der Innenelektroden sternförmig zusammen und bewirken dort ein besonders hohes elektrisches Feld.

35

Die bekannten Bauelemente haben den Nachteil, daß in dem Bereich großer Zugspannungen in der passiven Zone leichte Risse entstehen, die bei Dauerbelastung des Bauelements entlang der Innenelektroden ins Innere des Stapels verlängert werden können. Insbesondere können die Risse entlang der Innenelektroden wachsen. Dadurch wird die Lebensdauer der Bauteile begrenzt, was einen wesentlichen Nachteil für deren Anwendung bedeutet.

10 Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein piezoelektrisches Bauelement anzugeben, das eine hohe Lebensdauer aufweist.

15 Dieses Ziel wird durch ein erfindungsgemäßes piezoelektrisches Bauelement nach Patentanspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Bauelements sind den weiteren Patentansprüchen zu entnehmen.

20 Ein piezoelektrisches Bauelement enthält einen Stapel aus übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten und dazwischenliegenden Elektrodenschichten. Die Elektrodenschichten weisen im Innern des Stapels einen Mittelabschnitt sowie einen Endabschnitt auf. Der Endabschnitt ist dabei von der Innenseite einer vertikalen Randzone des Stapels begrenzt. Die
25 Endabschnitte der Elektrodenschichten sind von einem ersten piezoelektrischen Material umgeben, dessen relative Dehnung pro angelegter elektrischer Feldstärke geringer ist als die eines zweiten piezoelektrischen Materials, das in einem Mittelbereich zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten an-
30 geordnet ist.

Das erste piezoelektrische Material reicht vorzugsweise in die Randzone hinein.

35

Durch die Reduktion der Dehnung des keramischen Materials im Bereich der Endabschnitte der Elektrodenschichten kann die

mechanische Belastung in den Zonen der Endabschnitte reduziert werden. Dadurch hat die Erfindung den Vorteil, daß die Belastung der Materialien herabgesetzt und mithin die Lebensdauer des Bauelements erhöht wird. In der piezoelektrischen Schicht zwischen dem Endabschnitt einer Elektrodenschicht und der dieser Elektrodenschicht gegenüberliegenden Elektroden-
5 schicht entsteht somit ein Gradient in der relativen Dehnung, die maximal ist in der Mitte zwischen den beiden Elektroden-
schichten. Die Dehnung nimmt zu den Elektrodenschichten hin
10 ab.

Um einen besonders vorteilhaften Effekt der Steigerung der Lebensdauer des Bauelements zu erzielen, ist es vorteilhaft, wenn die relative Dehnung des ersten piezoelektrischen Mate-
15 rials höchstens 95 % der relativen Dehnung des zweiten piezo-
elektrischen Materials beträgt.

Als Maß für die relative Dehnung der piezoelektrischen Mate-
rialien kann die piezoelektrische Kenngröße d_{33} sowie eine
20 weitere piezoelektrische Kenngröße d_{31} verwendet werden. Die-
se Kenngrößen sind Elemente des piezoelektrischen Spannung-
stensors, wobei d_{33} die Ausdehnung des piezoelektrischen Ma-
terials in Richtung eines äußeren elektrischen Feldes paral-
lel zur Polungsrichtung beschreibt. Die zweite piezoelektri-
25 sche Kenngröße d_{31} beschreibt den Schrumpf des Materials in
einer Richtung senkrecht zur Richtung dieses elektrischen
Feldes. d_{33} und d_{31} haben entgegengesetztes Vorzeichen, wo-
durch die Erhaltung des Volumens der piezoelektrischen Kera-
mik zum Ausdruck kommt.

30 Vorteilhaft ist desweiteren, wenn der Unterschied der relati-
ven Ausdehnung zwischen dem ersten piezoelektrischen Material
und dem zweiten piezoelektrischen Material noch größer ist.
Dies ist der Fall, wenn die relative Dehnung des ersten pie-
35 zoelektrischen Materials höchstens 90 % der relativen Dehnung
des zweiten piezoelektrischen Materials beträgt.

Die erhöhte Belastung des piezoelektrischen Bauelements im Bereich der Elektrodenenden ist nicht streng auf das Ende der Innenelektroden lokalisiert, sondern betrifft auch den an die Elektrodenenden angrenzenden Bereich der Innenelektroden. Es ist daher vorteilhaft, wenn die von dem ersten piezoelektrischen Material umgebene Randzone wenigstens 5 % der Fläche der Elektrodenschicht aufweist.

Um die mechanische Stabilität des Bauelements zu erhöhen, ist es vorteilhaft, wenn der Übergang zwischen dem ersten piezoelektrischen Material und dem zweiten piezoelektrischen Material hinsichtlich der relativen Dehnung graduell, das heißt stetig erfolgt. Dadurch wird eine Grenzschicht zwischen zwei unterschiedlichen piezoelektrischen Materialien vermieden, was das Auftreten von Rissen im Material zusätzlich hemmen kann.

In einer vorteilhaften Ausführungsform erhält man einen graduellen Übergang zwischen den verschiedenen piezoelektrischen Materialien, indem das erste piezoelektrische Material gebildet ist aus dem zweiten piezoelektrischen Material durch Eindiffusion eines in den Elektrodenschichten vorhandenen Dotierstoffes. Durch Diffusion des Dotierstoffes, der die relative Dehnung des ihn umgebenden piezoelektrischen Materials vermindert, kann erreicht werden, daß nicht ein scharfer sondern ein gradueller Übergang zwischen verschiedenen Eigenschaften des piezoelektrischen Materials entsteht.

In einer vorteilhaften Ausführungsform können die Elektrodenschichten Kupfer enthalten, was gleichzeitig der Dotierstoff ist, der das Ausdehnungsverhalten eines piezoelektrischen Materials verändern kann.

Das erste piezoelektrische Material kann beispielsweise $\text{Pb}_{0,97} \text{Zr}_{0,54} \text{Ti}_{0,46} \text{Nd}_{0,02} \text{O}_3$ mit einem Anteil von 4 - 10 Mol-% an Kupfer sein. Das zweite piezoelektrische Material kann beispielsweise das eben genannte erste piezoelektrische

Material mit einem sehr geringen Anteil an Kupfer von zirka 2 Mol-% sein.

Die Erfindung kann desweiteren realisiert werden, indem das piezoelektrische Bauelement gebildet wird aus einem Stapel aus Schichten der Schichtfolge E-A-B-A-E. Dabei steht E für eine Elektrodenschicht, A für eine Keramikfolie, die das erste piezoelektrische Material enthält und B für eine Keramikfolie, die das zweite piezoelektrische Material enthält.

Dabei wäre darauf zu achten, daß der Sinterschwund der beiden piezoelektrischen Materialien aneinander angepaßt sein muß, um ein Reißen des piezoelektrischen Bauelements während des Sinterns zu verhindern. Außerdem muß darauf geachtet werden, daß die eingestellten Unterschiede in den Eigenschaften nicht durch Diffusion während der Sinterung teilweise oder ganz aufgehoben werden, das heißt, daß die Dotierstoffe eine begrenzte Mobilität aufweisen müssen.

In diesem Ausführungsbeispiel ist also der Stapel aus beispielsweise durch Siebdruck hergestellten Elektrodenschichten und durch Keramikfolien gebildeten piezoelektrischen Schichten aufgebaut.

Die Erfindung kann desweiteren realisiert werden, indem der Stapel gebildet ist aus Schichten der Schichtfolge E-C-B-C-E, wobei E für eine Elektrodenschicht, A für eine Keramikfolie, die das erste piezoelektrische Material enthält und C für eine Schicht steht, die durch zwei nebeneinanderliegende Siebdruckschichten gebildet ist. Die erste Siebdruckschicht erhält das erste piezoelektrische Material und bedeckt den Endabschnitt der benachbarten Elektrodenschicht. Die zweite Siebdruckschicht enthält das zweite piezoelektrische Material und bedeckt den Mittelabschnitt der benachbarten Elektrodenschicht von beiden Seiten.

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung bedecken die Siebdruckschichten zusammen die Schicht B vollständig und reichen jeweils bis zum inneren Rand des Endabschnitts der Elektrodenschicht. Dadurch wird erreicht, daß der Schichtauf-
5 bau ohne Dickenvariation und ohne Lücken über den gesamten Stapel fortgesetzt werden kann.

Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn das erfindungsgemäße Bauelement ein monolithischer Sinterkörper ist, der eine hohe
10 mechanische Stabilität erlaubt und der einfach und billig durch Gemeinsamsintern von übereinandergestapelten Schichten hergestellt werden kann.

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung eines piezoelek-
15 trischen Bauelements angegeben, wobei die Herstellung durch Sintern eines Stapels aus übereinanderliegenden Grünfolien und Elektrodenschichten erfolgt und wobei die Diffusion des Dotierstoffes von den Elektrodenschichten in das zweite Keramikmaterial während des Sinterns bei einer Temperatur zwi-
20 schen 800 und 1300°C erfolgt. Beispielsweise kommt bei der Dotierung mittels Kupfer eine Temperatur zwischen 950 und 1050°C und bei der Dotierung mittels Silber/Palladium eine Sintertemperatur zwischen 1000 und 1200°C in Betracht.

25 Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes piezo-
30 elektrisches Bauelement in einer perspektivischen Ansicht.

Figur 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Bauelements aus Figur 1 schematisch in einem Querschnitt.

35 Figur 3 zeigt ein beispielhaftes Konzentrationsprofil entlang der Linie K aus Figur 2.

Figur 3A zeigt ein angemessenes Konzentrationsprofil entlang der Linie K aus Figur 2.

Figur 4 zeigt verschiedene Zonen von Druckspannung und
5 Zugspannung nach dem Beispiel aus Figur 2.

Figur 5 zeigt beispielhaft ein weiteres erfindungsgemäßes piezoelektrisches Bauelement in einem schematischen Querschnitt.

10

Figur 6 zeigt beispielhaft ein weiteres erfindungsgemäßes piezoelektrisches Bauelement in einem schematischen Querschnitt.

15 Figur 1 zeigt einen Piezoaktor mit einem Stapel 1 von übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten 2 und Elektroden-
schichten 3a, 3b. Elektroden-schichten 3a einer ersten Sor-
te wechseln sich dabei mit Elektroden-schichten 3b einer zwei-
ten Sorte ab. Die Elektroden-schichten 3a, 3b jeweils einer
20 Sorte können durch einen außen am Stapel 1 anliegenden Me-
tallstreifen 13 gemeinsam kontaktiert werden. Durch Anlegen
von verschiedenen gepolten gepulsten elektrischen Spannungen an
die Elektroden-schichten 3a beziehungsweise die Elektroden-
schichten 3b kann erreicht werden, daß jeweils zwei einander
25 gegenüberliegende Elektroden-schichten 3a und 3b ein elektri-
sches Feld an den piezoelektrischen Schichten 2 erzeugen, wo-
durch ein vertikaler Hub des Piezoaktors erzeugt wird. Die
Elektroden-schichten 3a, 3b reichen jeweils von verschiedenen
Randbereichen des Stapels 1 kommend nicht bis hin zur gegen-
30 überliegenden Seite des Stapels 1, sondern lassen eine Rand-
zone 5 frei. Die Randzonen 5 des Stapels 1 sind die passiven
Zonen, in denen das piezoelektrische Material 2 im wesentli-
chen einer Zugspannung ausgesetzt ist. Dies wird auch in Fi-
gur 4 gezeigt. Der Bereich, in dem sich die Elektroden-schich-
ten 3a, 3b direkt überlappen, ist die aktive Zone 12, in dem
35 die piezoelektrischen Schichten im wesentlichen auf Druck be-
lastet werden (vgl. wiederum Figur 4).

Die Abmessungen des Bauelements können beispielsweise in der Grundfläche 7 x 7 mm und in der Höhe 30 mm betragen. Dabei gelingt es, eine Anzahl von bis zu 360 Innenelektroden in das piezoelektrische Bauelement zu integrieren. Es ist auch möglich, sogenannte Bieger herzustellen, die eine Grundfläche von 20 x 6 mm sowie eine Höhe von 1,5 mm aufweisen. Solche Bieger weisen zum Beispiel 20 Innenelektroden auf.

Die Elektrodenschichten 3a beziehungsweise die Elektrodenschichten 3b können jeweils in Form von Kammstrukturen ausgebildet sein, wobei die Kammstrukturen in Form von ineinandergeschobenen Kämmen in dem fertigen Bauelement angeordnet sind. Dadurch kann ein großer mechanischer Hub des Piezoaktors erreicht werden. Die Form der Elektrodenschichten 3a, 3b selbst ist dabei beliebig, wesentlich ist lediglich, daß in einem Bereich senkrecht zur Ebene der Elektroden, der sogenannten passiven Zone, nur jede zweite Elektrode vorhanden ist.

20

Für die piezoelektrische Schicht 2 können die üblicherweise verwendeten PZT-Keramiken benutzt werden.

Figur 2 zeigt einen Detailausschnitt des Bauelements aus Figur 1. Die Elektrodenschichten 3a, 3b sind umgeben von einem ersten Keramikmaterial 7, das eine geringere relative Dehnung bei Anlegen einer elektrischen Spannung aufweist. Zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten 3a, 3b ist in einem Mittelbereich 8 ein zweites piezoelektrisches Material 9 mit einer höheren relativen Dehnung angeordnet. Das erste piezoelektrische Material 7 umgibt nicht nur den Endabschnitt der Elektrodenschichten 3a, 3b, sondern die Elektrodenschichten 3a, 3b als Ganzes. Das erste piezoelektrische Material 7 wird erzeugt aus dem zweiten piezoelektrischen Material 9 durch Eindiffundieren von in den Elektrodenschichten 3a, 3b vorhandenen Dotierstoffen. Als Dotierstoff kommt beispielsweise Kupfer in Betracht. Das Dotieren kann vorgenommen werden

durch einen Temperaturschritt, der während des Sinterns des Bauelements ausgeübt wird.

Figur 3 zeigt modellhaft die relative Konzentration c eines Dotierstoffes entlang der Linie K aus Figur 2. An den Positionen Z_1 und Z_2 sind jeweils die Elektrodenschichten 3b beziehungsweise 3a angeordnet. Zwischen den Positionen Z_1 und Z_3 besteht eine langsame abnehmende Dotierstoffkonzentration, die sich zwischen einer maximalen Dotierstoffkonzentration $c_{\max}$ und einer minimalen Dotierstoffkonzentration $c_{\min}$ bewegt. In dieser Zone befindet sich das erste piezoelektrische Material 7, das eine relativ niedrige Dehnung aufweist. Die niedrige Dehnung kommt zustande durch Modifikation des zweiten piezoelektrischen Materials 9, das eine hohe Dehnung aufweist. Zwischen den Positionen Z_3 und Z_4 befindet sich eine Zone mit relativ geringer Dotierstoffkonzentration $c_{\min}$, wobei es sich hier um das zweite piezoelektrische Material 9 mit einer hohen relativen Dehnung handelt. $c_{\min}$ kann sehr klein und gegebenenfalls auch gleich Null sein.

20

Figur 3 ist auch zu entnehmen, daß durch Modifikation des zweiten piezoelektrischen Materials 9 mittels Dotierung ein gradueller Übergang zwischen den verschiedenen piezoelektrischen Materialien 7, 9 geschaffen werden kann.

25

Die Elektrodenschichten 3a, 3b können beispielsweise in Form von Siebdruckelektroden in einem Abstand von 20 bis 200 μm ausgeführt sein. Als Dotierstoffe kommen neben Kupfer noch weitere chemische Elemente in Betracht. Insbesondere kommen in Betracht diejenigen Dotierstoffe, die zur Herstellung härterer PZT-Keramiken verwendet werden, wenn die piezoelektrischen Konstanten mit zunehmender Konzentration abnehmen.

35

Die Dotierstoffkonzentration c nimmt dabei ausgehend von den Elektrodenschichten 3a, 3b hin zum Mittelbereich 8 zwischen den Elektrodenschichten 3a, 3b kontinuierlich ab. Dadurch wird sichergestellt, daß sich insbesondere in der Nähe der

Elektrodenschichten 3a, 3b ein piezoelektrisches Material befindet, das eine geringe relative Dehnung aufweist.

Figur 3A zeigt beispielhaft die Konzentration des Dotierstoffes Kupfer in Gew.-% entlang der Linie K aus Figur 2. Dabei ist die Kupferkonzentration C_{Kupfer} in Abhängigkeit vom Abstand d von der bei Z_2 befindlichen Innenelektrode dargestellt. Bei $d = 70 \mu\text{m}$ befindet sich die zweite Innenelektrode 3b, was der Position Z_1 aus Figur 2 beziehungsweise aus Figur 3 entspricht. Es wurde dabei von der Keramik $\text{Pb}_{0,97}\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46}\text{Nd}_{0,02}\text{O}_3$ als zweitem piezoelektrischen Material ausgegangen. Die Innenelektroden 3a, 3b sind in dem Beispiel nach Figur 3A als Kupferelektroden ausgeführt. Durch Diffusion während des Sinterns bei einer Temperatur von 1000°C und einer Dauer von etwa 5 Stunden wurde das in Figur 3A durch WDX/EDX-Messung gemessene Konzentrationsprofil erreicht. Der Konzentrationsverlauf des Kupfers in dem zweiten piezoelektrischen Material entspricht qualitativ dem in Figur 3 modellhaft angegebenen Konzentrationsverlauf. Im Bereich zwischen einem Abstand $d = 0$ und $d = 18 \mu\text{m}$ beziehungsweise in einem Bereich zwischen $d = 45$ und $d = 70 \mu\text{m}$ wurde durch Eindiffusion des Kupfers aus den Innenelektroden 3a, 3b ein erstes piezoelektrisches Material erzeugt, das eine geringere relative Dehnung als das zweite piezoelektrische Material aufweist. Dabei beschreibt die erste Kurve 14 das Ausgangsmaterial für das zweite piezoelektrische Material wie oben angegeben und die zweite Kurve 15 als Ausgangsmaterial dasselbe Material wie oben angegeben und bei der ersten Kurve 14 dargestellt, jedoch noch mit einer zusätzlichen Kupferdotierung von ca. 1 bis 2 Mol%. Ein Mol% Cu-Konzentration entspricht dabei 0,196 Gew.-%.

Bei dem oben angegebenen Bleizirkontitanat kann eine relative Dehnung von 690 pm/V durch Dotierung mit mehr als 1 Mol% Kupfer so reduziert werden, daß eine relative Dehnung von $< 650 \text{ pm/V}$ resultiert. Die relativen Dehnungen werden dabei als Auslenkung eines vorgespannten Aktors im Vielschichtaufbau

gemessen, der geeignet gepolt wurde und mit einer Feldstärke von etwa 2 KV/mm beaufschlagt wurde. Durch Erhöhung des Kupferanteils kann die relative Dehnung weiter verringert werden.

5

Figur 4 zeigt die Verhältnisse im unteren Bereich von Figur 2 bezüglich des Auftretens von Druck- beziehungsweise Zugspannungen bei elektrischer Belastung des Aktors und deren relative Stärke. In der aktiven Zone 12 tritt in der Hauptsache Druckspannung auf. In den mit 7 bezeichneten Zonen gilt, daß die auftretende Druckspannung relativ gering ist, aufgrund der geringen Dehnung des ersten piezoelektrischen Materials. In der mit 9 bezeichneten Zone ist die auftretende Druckspannung relativ groß, da hier das zweite piezoelektrische Material angeordnet ist. In den Randzonen 5 tritt anstelle der Druckspannung eine Zugspannung auf. Die Druckspannungen werden symbolisiert durch <-->, die Zugspannungen werden symbolisiert durch >--<. Die Länge der Doppelpfeile ist dabei lediglich ein grober Anhaltspunkt, insbesondere geht die angegebene Spannung nicht proportional mit der Länge der Pfeile.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei entsprechend auf einen Piezoaktor gemäß Figur 1 Bezug genommen wird. Im Unterschied zu Figur 2 ist gemäß Figur 5 das erste piezoelektrische Material nicht durch Diffusion eines Dotierstoffes, sondern von Haus aus durch Verwenden einer entsprechenden keramischen Grünfolie hergestellt. Figur 5 beschreibt also einen Schichtstapel der Abfolge E-A-B-A-E. Über eine Elektroden-schicht 3b wird dabei eine keramische Grünfolie, die ein erstes piezoelektrisches Material 7 enthält, gelegt. Darauf folgt eine keramische Grünfolie, die ein zweites piezoelektrisches Material 9 enthält. Es folgt wieder entsprechend der Abfolge eine Schicht A und dann eine Elektroden-schicht 3a. Die in den Keramikschichten für A und B verwendeten Keramikfolien können jeweils auf einer PZT-basierten Keramik beruhen, wobei die Einstellung der relativen Dehnung

der jeweiligen Piezokeramik beziehungsweise des piezoelektrischen Materials 7, 9 entweder durch das Beifügen von einem oder mehreren Dotierstoffen oder durch Variation des Zirkon/Titan-Verhältnisses erfolgt. Es können die beiden genannten Maßnahmen auch kombiniert werden.

Die Schichtdicken der keramischen Grünfolien können dabei zwischen 20 und 200 μm betragen. Auch andere Schichtdicken sind möglich.

10

Die Dicke der Elektrodenschichten 3a, 3b beträgt zwischen 5 und 10 μm .

Auch in der Ausführungsform gemäß Figur 5 gilt, daß nicht nur die Endabschnitte 6 der Elektrodenschichten 3a, 3b, sondern die gesamten Elektrodenschichten 3a, 3b von einem ersten piezoelektrischen Material 7 mit niedriger relativer Dehnung umgeben sind.

Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei der Aufbau des Stapels 1 entsprechend Figur 5 erfolgt, wobei jedoch in der Schichtabfolge die Schicht A durch die Schicht C ersetzt wird. Die Schicht C ist dabei nicht gebildet durch eine keramische Grünfolie, sondern sie ist zusammengesetzt aus zwei Siebdruckschichten 10, 11. Diese beiden Siebdruckschichten 10, 11 ergänzen sich zu einer über den gesamten Querschnitt des Piezoaktors durchgehenden Schicht C. Die Siebdruckschichten 10, 11 haben den Vorteil, daß sie wesentlich dünner als die keramischen Grünfolien gemäß Figur 5 ausgeführt sein können. Dadurch wird der Vorteil erzielt, daß der Gesamthub des Piezoaktors möglichst wenig beeinträchtigt wird. So ist es beispielsweise möglich, Siebdruckschichten 10, 11 mit einer Dicke von 3 bis 10 μm herzustellen. Die Siebdruckschicht 10 enthält ein erstes piezoelektrisches Material 7 mit geringer relativer Dehnung. Die Siebdruckschicht 10 bedeckt dabei jeweils auf der Oberseite und auf der Unterseite den jeweiligen Endabschnitt 6 der Elektrodenschicht 3a,

3b. Dadurch ist also der Endabschnitt 6 der Elektrodenschichten 3a, 3b von dem ersten piezoelektrischen Material 7 umgeben. Die die Siebdruckschichten 10 zu einer vollen Stapelschicht C ergänzende Siebdruckschicht 11 bedeckt jeweils den
5 Mittelabschnitt 4 der Elektrodenschichten 3a, 3b auf der Oberseite und auf der Unterseite. Die Siebdruckschicht 11 enthält dabei das zweite piezoelektrische Material 9, das sich auch in dem Mittelbereich 8 zwischen den benachbarten Elektrodenschichten 3a, 3b befindet.

10

Durch den Aufbau gemäß Figur 6 wird erreicht, daß lediglich die kritischen Endabschnitte 6 der Elektrodenschichten 3a, 3b von dem ersten piezoelektrischen Material umhüllt sind. Dadurch wird der Vorteil erzielt, daß der Gesamthub des Piezo-
15 aktors möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Bei der Erfindung ist es wesentlich, daß die Endabschnitte der Elektrodenschichten von einem piezoelektrischen Material relativ geringer Dehnung umgeben sind. Die Erfindung ist
20 nicht beschränkt auf Ausführungen, bei denen die gesamten Elektrodenschichten von dem ersten piezoelektrischen Material umgeben sind.

Bezugszeichenliste

	1	Stapel
	2	piezoelektrische Schicht
5	3a, b	Elektrodenschichten
	4	Mittelabschnitt
	5	Randzone
	6	Endabschnitt
	7, 9	piezoelektrisches Material
10	8	Mittelbereich
	10, 11	Siebdruckschichten
	12	aktive Zone
	13	Metallstreifen
	Z, Z ₁ , Z ₂ , Z ₃ , Z ₄	Z-Koordinaten
15	c, c _{max} , c _{min}	Dotierstoffkonzentration
	d	Abstand
	C _{Kupfer}	Kupferkonzentration
	14	erste Kurve
	15	zweite Kurve

Patentansprüche

1. Piezoelektrisches Bauelement

- mit einem Stapel (1) aus übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektroden-
- 5 schichten (3a, 3b)
- bei dem Elektroden-schichten (3a, 3b) im Innern des Stapels (1) einen Mittelabschnitt (4) sowie einen von der Innenseite einer vertikalen Randzone (5) des Stapels (1) begrenzten En-
- 10 dabschnitt (6) aufweisen
- bei dem die Endabschnitte (6) der Elektroden-schichten (3a, 3b) von einem ersten piezoelektrischen Material (7) umgeben sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materials (9), das in
- 15 einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektroden-schichten (3a, 3b) angeordnet ist.

2. Bauelement nach Anspruch 1,

- bei dem die relative Dehnung des ersten piezoelektrischen Ma-
- 20 terials (7) höchstens bei 95 % der relativen Dehnung des zweiten piezoelektrischen Materials (9) beträgt.

3. Bauelement nach Anspruch 2,

- bei dem die relative Dehnung des ersten piezoelektrischen Ma-
- 25 terials (7) höchstens bei 90 % der relativen Dehnung des zweiten piezoelektrischen Materials (9) beträgt.

4. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

- bei dem die Fläche einer Randzone (6) wenigstens 5 % der Flä-
- 30 che der Elektroden-schicht (3a, 3b) aufweist.

5. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

- bei dem der Übergang in der relativen Dehnung zwischen dem
- ersten und dem zweiten piezoelektrischen Material (7, 9) ste-
- 35 tig ist.

6. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

bei dem das erste piezoelektrische Material (7) gebildet ist aus dem zweiten piezoelektrischen Material (9) durch Eindiffusion eines aus den Elektrodenschichten (3a, 3b) stammenden Dotierstoffes.

5

7. Bauelement nach Anspruch 6,
bei dem der Dotierstoff Kupfer ist.

8. Bauelement nach Anspruch 6,

10 bei dem das erste piezoelektrische Material (7) $\text{Pb}_{0,97} \text{Zr}_{0,56} \text{Ti}_{0,46} \text{Nd}_{0,02} \text{O}_3$ mit einem Anteil von mit einem Anteil von 3 - 10 Mol-% Cu und das zweite piezoelektrische Material (9) $2 \text{Pb}_{0,97} \text{Zr}_{0,56} \text{Ti}_{0,46} \text{Nd}_{0,02} \text{O}_3$ mit einem Anteil von mit einem Anteil von 1 - 2 Mol-% Cu ist.

15

9. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

- bei dem der Stapel (1) aus Schichten der Schichtfolge E-A-B-A-E gebildet ist,

- bei dem E für eine Elektrodenschicht (3a, 3b),

20 - bei dem A für eine Keramikfolie enthaltend das erste piezoelektrische Material (7),

- und bei dem B für eine Keramikfolie enthaltend das zweite piezoelektrische Material (9) steht.

25 10. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

- bei dem der Stapel (1) gebildet ist aus Schichten der Schichtfolge E-C-B-C-E,

- bei dem E für eine Elektrodenschicht (3a, 3b),

30 - bei dem A für eine Keramikfolie enthaltend das erste piezoelektrische Material (7),

- bei dem C für eine Schicht steht, die durch zwei nebeneinanderliegende Siebdruckschichten (10, 11) gebildet ist,

- bei dem die erste Siebdruckschicht (10) das erste piezoelektrische Material (7) enthält und den Endabschnitt (6) der

35 benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) bedeckt,

- und bei dem die zweite Siebdruckschicht (11) das zweite piezoelektrische Material (9) enthält und den Mittelabschnitt (4) der benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) bedeckt.

5 11. Bauelement nach Anspruch 10,
bei dem die Siebdruckschichten (10, 11) die Schicht B vollständig bedecken und jeweils bis zum inneren Rand des Endabschnitts (6) der benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) reichen.

10

12. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
bei dem der Stapel (1) ein monolithischer Sinterkörper ist.

13. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
15 bei dem die Elektrodenschichten (3a, 3b) Kupfer enthalten.

14. Verfahren zur Herstellung eines piezoelektrischen Bauelements mit einem Stapel (1) aus übereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektrodenschichten (3a, 3b), bei dem die Elektrodenschichten (3a, 3b) von einem ersten piezoelektrischen Material (7) umgeben sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materials (9), das in einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten (3a, 3b) angeordnet ist,
25 wobei die Herstellung durch Sintern eines Stapels (1) aus übereinanderliegenden keramischen Grünfolien und Elektroden-
schichten (3a, 3b) erfolgt und
wobei das erste piezoelektrische Material (7) gebildet wird
30 aus dem zweiten piezoelektrischen Material (9) durch Eindiffundieren von in den Elektrodenschichten (3a, 3b) enthaltenen Dotierstoffen während einer Dauer von 4 bis 10 h bei einer Temperatur zwischen 800°C und 1500°C, welche während des Sinterns des Stapels (1) erreicht wird.

$\frac{1}{4}$

FIG 1

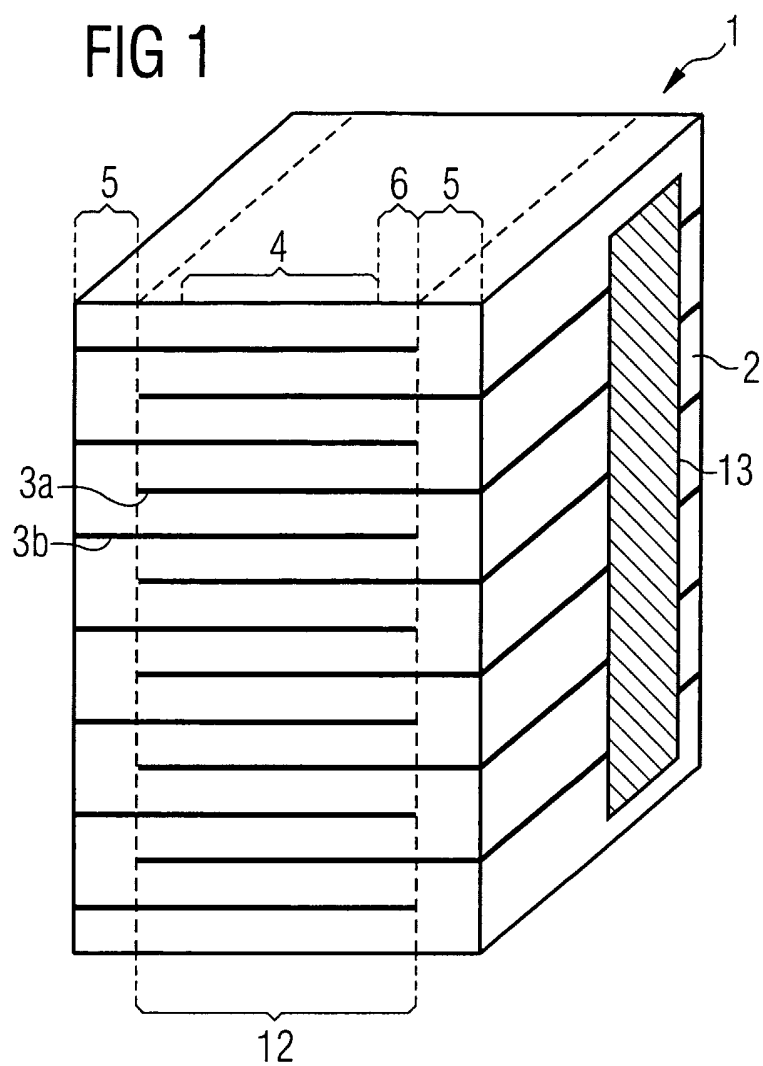
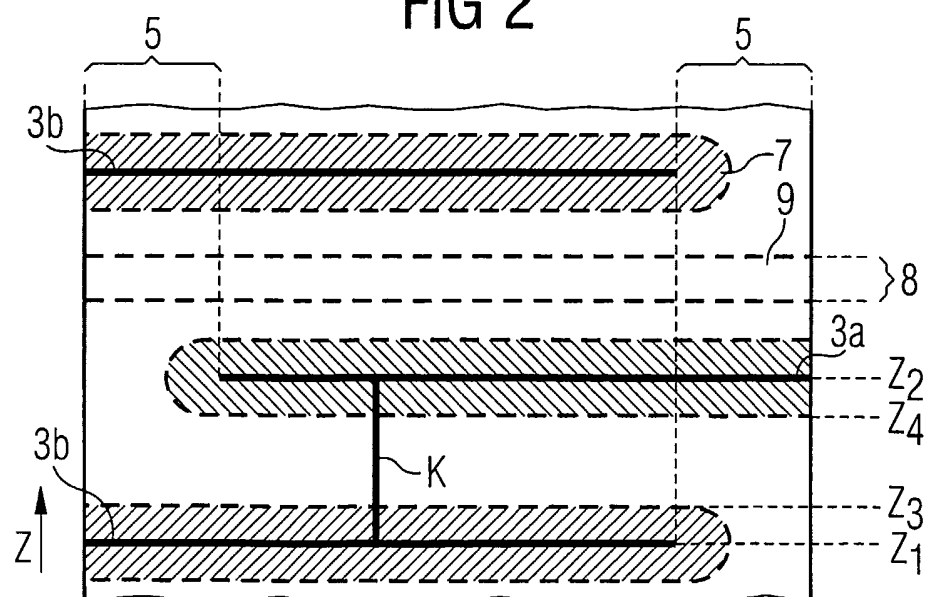


FIG 2



2/4

FIG 3

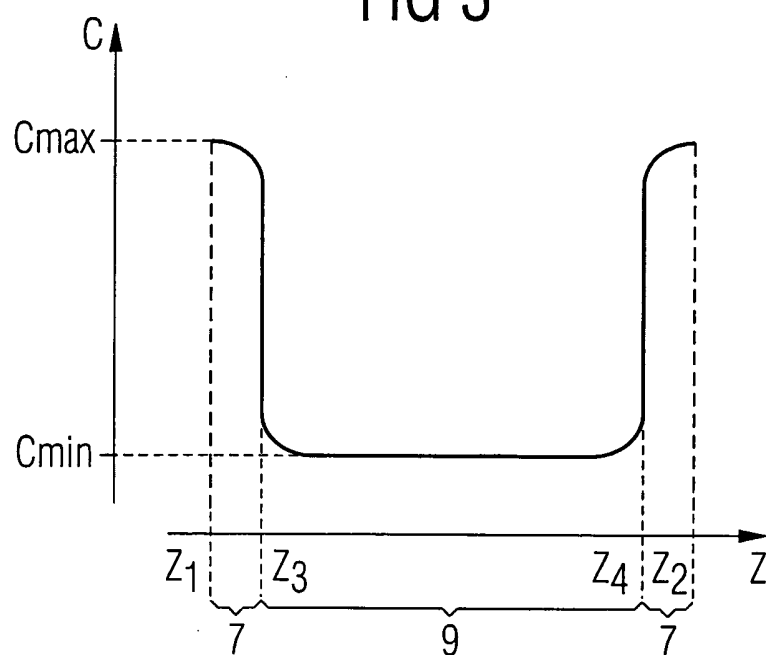


FIG 3A

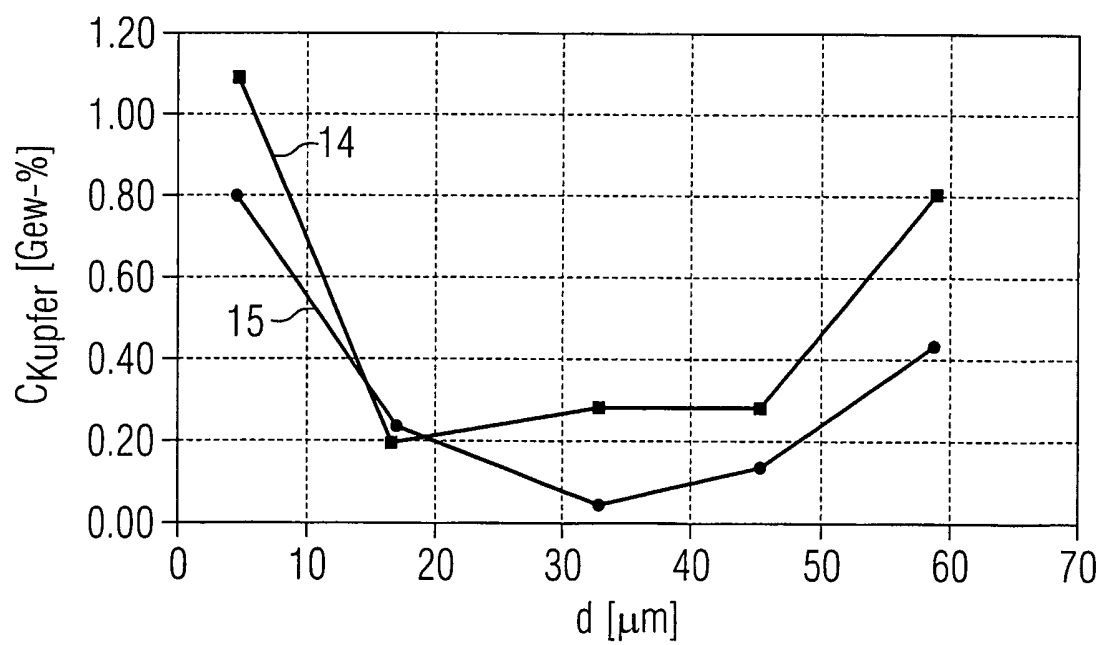


FIG 4

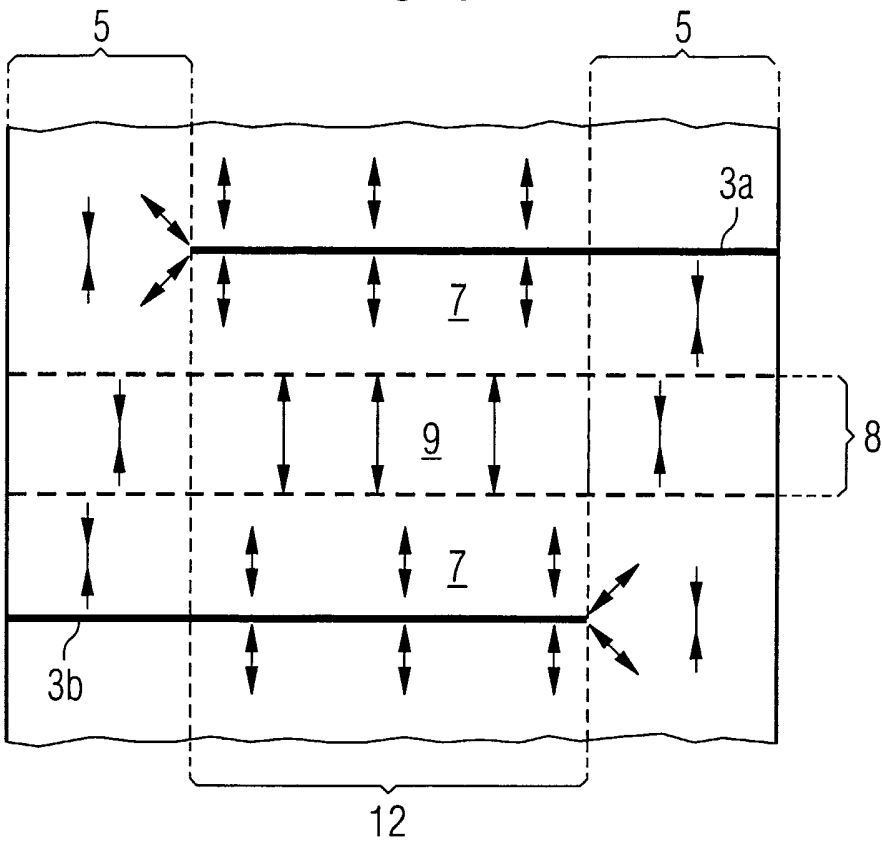


FIG 5

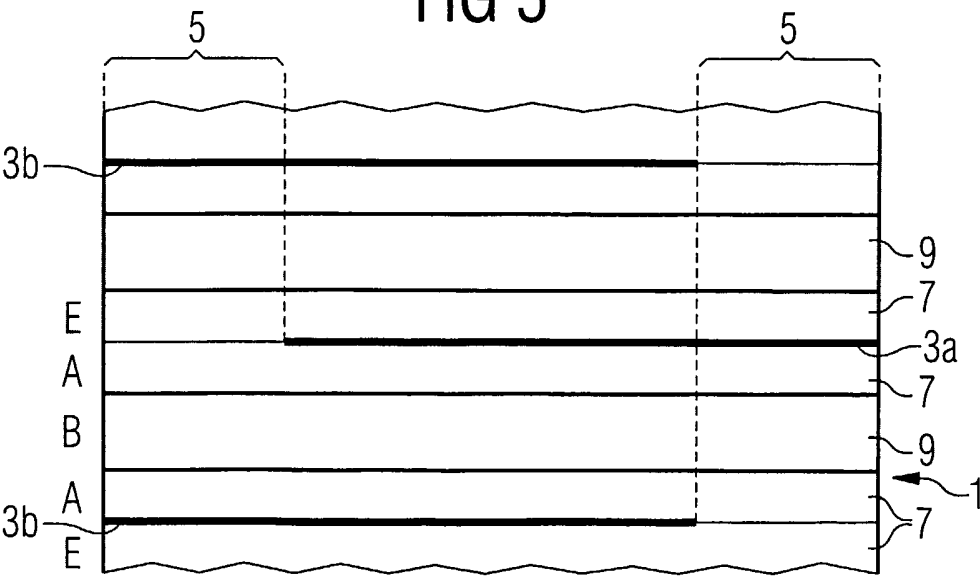


FIG 6

